

ナノ3D光干渉計測システムによる ナノ3D計測ソリューション

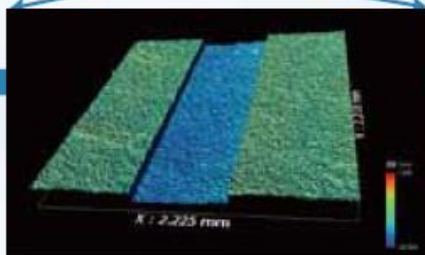


対物レンズ影響を受けない 垂直分解能
Vertical resolution not affected by objective lens

×110

視野(Field of view)
: 43 x 32 μm

視野: 2252 x 2252 μm
(Field of view)
段差: 3 nm
(Step height)

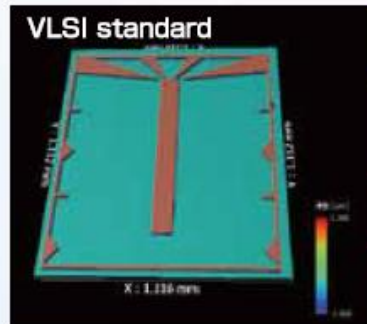


×2.5

視野 (Field of view)
: 6436 x 6436 μm

倍率が変わっても垂直分解能は0.01 nm~

Vertical resolution is 0.01 nm~
even if magnification changes

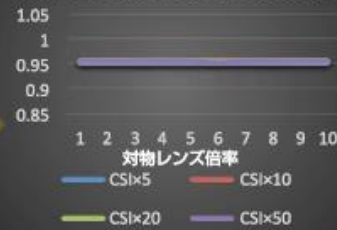


VLSI 標準段差サンプル
0.9532 μm ± 0.0057 μm 段差
10回繰り返し再現性

10 consecutive measurements using
VLSI standard (0.9532 μm ± 0.0057 μm steps)

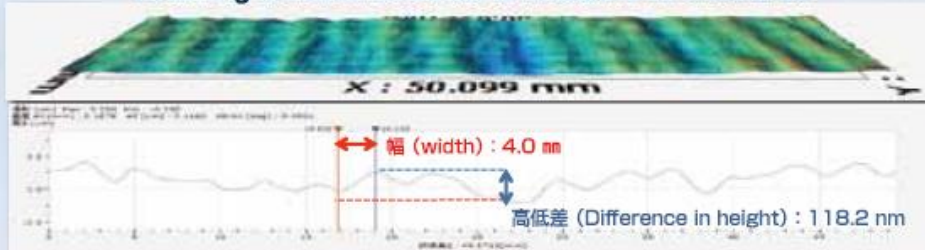
3σ : 1.8 nm
高い再現性で測定可能
3σ : 1.8 nm
High repeatability measurement
is possible

VS1800 10回測定
[μm] 10 times Measurement



画像連結機能で より広範囲の測定が可能

Stitching function enables to measure in wide area



フィルム塗工すじムラ 視野 測定長50 mm Film coating streak unevenness Field of view Measuring length 50 mm

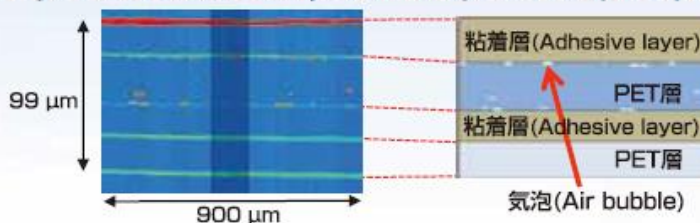
表面形状だけでなく、透明体層断面解析も可能

Not only topography but also layer cross section analysis of transparent sample is possible

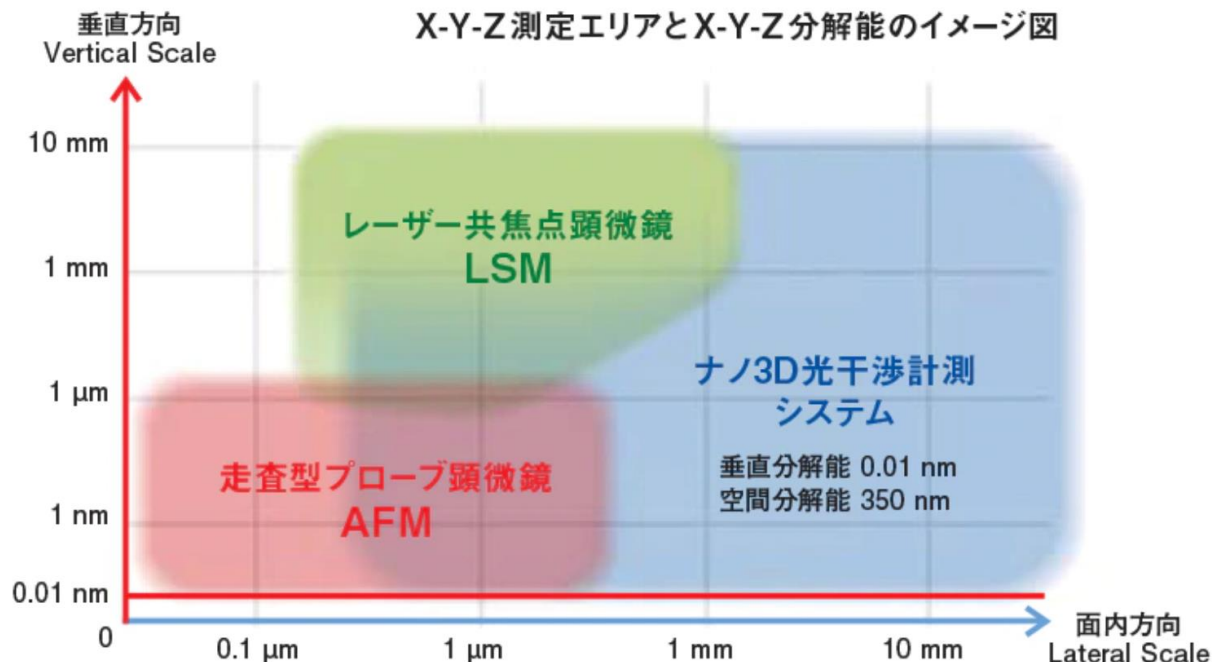
膜厚(層断面解析)
Layer film thickness
(Layer cross section analysis)

視野: 幅 900 μm
(Field of view)

全体厚: 約 99 μm
(Overall thickness)



X-Y-Z測定エリアとX-Y-Z分解能のイメージ図



ナノ3D光干渉計測システム VS1800の主な仕様

機種		Type 1	Type 2	Type 3
Z軸	モーター駆動	標準搭載 (最大測定Zレンジ~10 mm)		
	PZT駆動	追加オプション (最大測定Zレンジ~150 μm)		
XYステージ	駆動方式	手動	電動	
	移動領域	±50 mm	±75 mm	
	ステージサイズ	W205 × D150 mm	W225 × D225 mm	
ゴニオステージ	駆動方式	手動		電動
	移動領域	±2°	±5°	
測定用カメラ		標準カメラ または 高画素カメラ		
鏡筒		×1 または ×0.5		
ズームレンズ		×0.7レンズ (追加オプション)		
対物レンズ		×2.5 ×5 ×10 ×20 ×50 ×110		
サンプル高さ	標準	0~50 mm		
	追加オプション			
	かさ上げキット使用時	50~100 mm	0~100 mm	



* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。

